

G01Q 走査プロ - プ技術または装置; 走査プロ - プ技術の応用, 例. 走査プロ - プ型顕微鏡 [SPM][2010.01]

注

このサブクラスにおいては、ファ - ストプレイス優先ル - ルが適用となる、すなわち各階層レベルにおいて、相反する指示がない限り、最初の適切な箇所に分類する。
[2010.01]

| | |
|-----------|---|
| 10/00 | 走査または位置決め装置、すなわち、プロ - プの動きあるいは位置を積極的に制御するための装置 [2010.01] |
| 10/02 | ・粗動走査または粗動位置決め [2010.01] |
| 10/02 101 | ・圧電素子を用いたもの |
| 10/02 111 | ・それらのための回路またはアルゴリズム |
| 10/04 | ・微動走査または微動位置決め [2010.01] |
| 10/04 101 | ・圧電素子を用いたもの |
| 10/06 | ・それらのための回路またはアルゴリズム [2010.01] |
| 20/00 | プロ - プの動きまたは位置の監視 [2010.01] |
| 20/02 | ・光学的手段によるもの [2010.01] |
| 20/04 | ・自己検知プロ - プ、すなわち、プロ - プ自身がその位置を示すような信号を発するもの、例. 圧電ゲ - ジ [2010.01] |
| 30/00 | 走査プロ - プ技術または装置の補助または改良に資する補助的手段、例. 表示装置またはデ - タ処理装置 [2010.01] |
| 30/02 | ・非 SPM 分析装置、例. SEM[走査型電子顕微鏡], 分光計または光学顕微鏡 [2010.01] |
| 30/04 | ・表示装置またはデ - タ処理装置 [2010.01] |
| 30/06 | ・エラ - 補償のためのもの [2010.01] |
| 30/08 | ・サンプルチェンバ - 内に所望の環境条件を確立し調節するための手段 [2010.01] |
| 30/10 | ・温度環境 [2010.01] |
| 30/12 | ・流体環境 [2010.01] |
| 30/14 | ・液体環境 [2010.01] |
| 30/16 | ・真空環境 [2010.01] |
| 30/18 | ・外部の環境条件または影響からサンプルチェンバ - の内部を保護しあるいは隔離するための手段 [2010.01] |
| 30/20 | ・試料の取扱装置または手段 [2010.01] |
| 40/00 | キャリブレ - ション、例. プロ - プのキャリブレ - ション [2010.01] |
| 40/02 | ・キャリブレ - ションの基準またはその製造方法 [2010.01] |
| 60/00 | 特定の型の SPM[走査プロ - プ型顕微鏡] またはそのための装置; その基本的な構成部品 [2010.01] |
| 60/00 101 | ・プロ - プの特性 |
| 60/02 | ・マルチタイプ SPM, すなわち 2 つまたはそれ以上の SPM 技術を使用するもの [2010.01] |
| 60/04 | ・STM[走査型トンネル顕微鏡法] と AFM[原子間力顕微鏡法] の組合せ [2010.01] |
| 60/06 | ・SNOM[近視野光学顕微鏡法] と AFM[原子間力顕微鏡法] の組合せ [2010.01] |
| 60/08 | ・MFM[磁気力顕微鏡法] と AFM[原子間力顕微鏡法] の組合せ [2010.01] |

| | |
|-----------|--|
| 60/10 | ・STM[走査型トンネル顕微鏡法] またはそのための装置、例. STM 用プロ - プ [2010.01] |
| 60/12 | ・STS[走査型トンネルスペクトロスコピ -] [2010.01] |
| 60/14 | ・STP[走査型トンネルポテンシオメトリ -] [2010.01] |
| 60/16 | ・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01] |
| 60/16 101 | ・プロ - プの特性 |
| 60/16 111 | ・プロ - プの製造 |
| 60/18 | ・SNOM[近視野光学顕微鏡法] またはそのための装置、例. SNOM 用のプロ - プ [2010.01] |
| 60/20 | ・蛍光 [2010.01] |
| 60/22 | ・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01] |
| 60/22 101 | ・プロ - プの特性 |
| 60/22 111 | ・プロ - プの製造 |
| 60/24 | ・AFM[原子間力顕微鏡法] またはそのための装置、例. AFM 用のプロ - プ [2010.01] |
| 60/26 | ・摩擦力顕微鏡法 [2010.01] |
| 60/28 | ・凝着力顕微鏡法 [2010.01] |
| 60/30 | ・走査型ポテンシャル顕微鏡法 [2010.01] |
| 60/32 | ・AC モ - ド [2010.01] |
| 60/34 | ・タッピングモ - ド [2010.01] |
| 60/36 | ・DC モ - ド [2010.01] |
| 60/38 | ・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01] |
| 60/38 101 | ・プロ - プの特性 |
| 60/38 111 | ・プロ - プの製造 |
| 60/40 | ・導電性プロ - プ [2010.01] |
| 60/42 | ・機能化 [2010.01] |
| 60/44 | ・SICM[走査型イオンコンダクタンス顕微鏡法] またはそのための装置、例. SICM 用のプロ - プ [2010.01] |
| 60/44 101 | ・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - |
| 60/46 | ・SCM[走査型キャパシタンス顕微鏡法] またはそのための装置、例. SCM 用のプロ - プ [2010.01] |
| 60/48 | ・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01] |
| 60/50 | ・MFM[磁気力顕微鏡法] またはそのための装置、例. MFM 用のプロ - プ [2010.01] |
| 60/52 | ・磁気共鳴 [2010.01] |
| 60/54 | ・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01] |
| 60/54 101 | ・プロ - プの特性 |
| 60/54 111 | ・プロ - プの製造 |
| 60/56 | ・磁気コ - ティングされたプロ - プ [2010.01] |
| 60/58 | ・SThM[走査型熱顕微鏡法] またはそのための装置、例. SThM 用のプロ - プ [2010.01] |
| 60/60 | ・SECM[走査型電気化学顕微鏡法] またはそのための装置、例. SECM 用のプロ - プ [2010.01] |
| 60/60 101 | ・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - |

| | |
|-----------|--|
| 70/00 | SPM プロ - プの一般的観点またはその製造または関連する器具類で , グル - プ G01Q60/00 に包含される単一の SPM 技術に特に適合していないもの [2010.01] |
| 70/02 | ・プロ - プホルダ - [2010.01] |
| 70/04 | ・温度・震動に誘引されたエラ - の補償のあるもの [2010.01] |
| 70/06 | ・プロ - プチップアレイ [2010.01] |
| 70/08 | ・プロ - プの特性 [2010.01] |
| 70/10 | ・形状またはテ - パ [2010.01] |
| 70/12 | ・ナノチュ - プチップ [2010.01] |
| 70/14 | ・特定の物質 [2010.01] |
| 70/16 | ・プロ - プの製造 [2010.01] |
| 70/18 | ・機能化 [2010.01] |
| 80/00 | SPM を除く走査プロ - プ技術の応用 (マイクロ構造の製造または処理 B81C; ナノ構造物の製造または処理 B82B3/00; 近接場相互作用を用いる情報の記録と再生 G11B9/12, G11B11/24, G11B13/08) [2010.01] |
| 80/00 101 | ・情報記録装置への適用 |
| 80/00 111 | ・表面加工への適用 |
| 80/00 121 | ・生物試料への適用 |
| 90/00 | 他に分類されない走査プロ - プ技術または装置 [2010.01] |
